

Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металевих заготовок, що полягає в деформуванні заготовки в діелектричну матрицю за рахунок впливу імпульсним магнітним полем, який **відрізняється** тим, що робочу поверхню матриці, що прилягає до заготовки, покривають тонким металевим шаром - накладкою, товщину якої вибирають меншою, чим величина скін-шару для даного металу, тобто визначають з співвідношення:

$$d < \frac{2}{\sqrt{2\omega\mu_0\gamma}},$$

де

d - товщина металевої накладки матриці;

γ - електропровідність металу накладки;

ω - циклічна частота діючого поля;

μ_0 - магнітна стала.